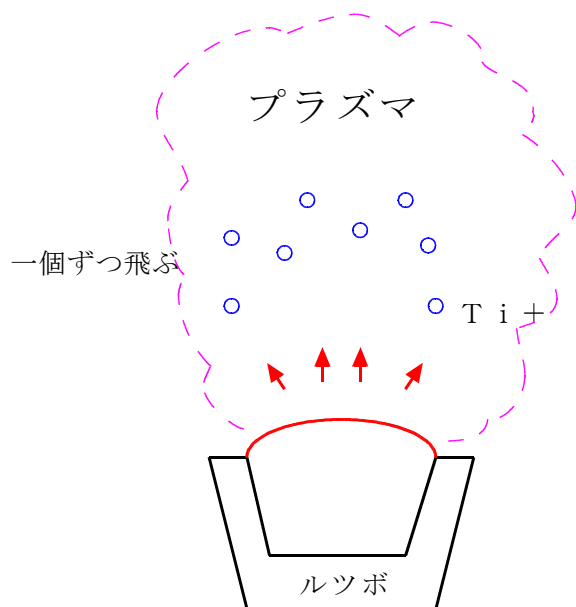
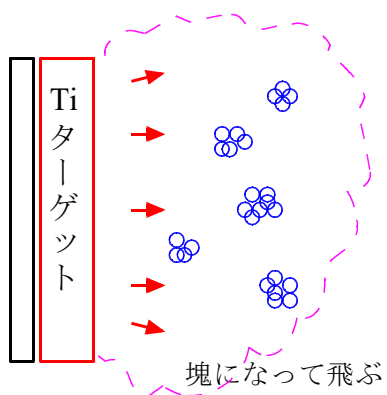


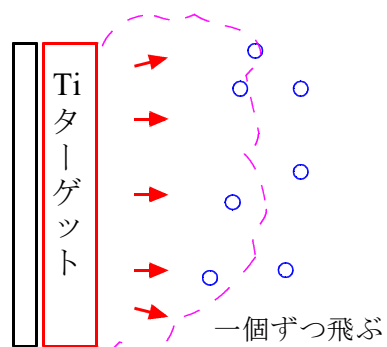
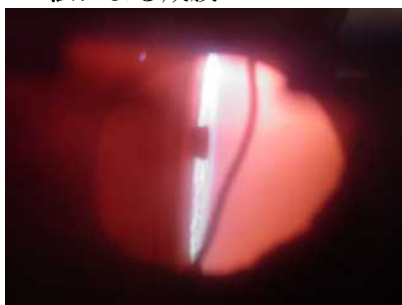
成膜方法の代表



HCD法（蒸着など）の溶解法による成膜



AIP法による成膜

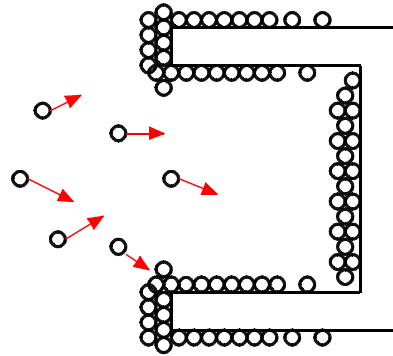


スパッタ法による成膜

HCD法の成膜

利点 高密着力
緻密できれいな膜

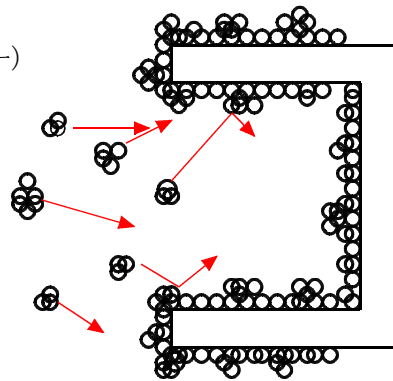
欠点 制御が難しい



AIP法の成膜

利点 さらに高い密着力 (大きい運動エネルギー)
ターゲットの調整で合金が可能

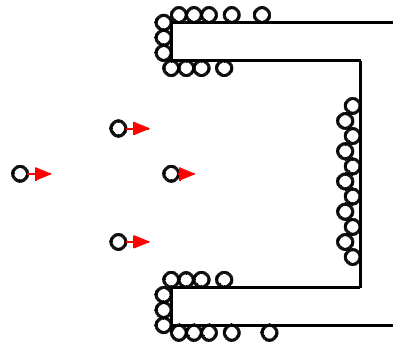
欠点 ドロップレットと呼ばれる粒が着く
細かい物 (マイクロドリル) は折れやすい



スパッタ法の成膜

利点 きれいな膜
合金が可能

欠点 反応性が弱い
厚膜が困難



*本説明は、概略を説明する為、誇張する表現が含まれています。

株式会社サーフテック